



# شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

بهمن ماه ۱۳۹۴

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

## ادریابی رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش‌های نانوساختار TiAlCrN ایجاد شده به روش تبخیر قوس کاتدی

مصطفی مقداری<sup>۱</sup>، روح الله رحمانی فرد<sup>۲</sup>، حسن علم خواه<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری های نوین

<sup>۲</sup>. دانشگاه برعالي سينا، دانشکده فني و مهندسي، گروه مواد

### چکیده

در این پژوهش رفتار خوردگی سه نوع پوشش نیتریدی برپایه TiAlCrN اعمال شده با استفاده از روش تبخیر قوس کاتدی با دو منبع تبخیری مختلف بر روی فولاد زنگ تزن ۳۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. پوشش‌های ایجاد شده در محیط ۳/۵ درصد وزنی نمک طعام، تحت آزمون خوردگی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک قرار گرفتند و سپس پارامترهای خوردگی پوشش‌ها از طریق شبیه‌تالی و انتخاب مدار معادل الکتریکی پوشش استخراج شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد تیتانیوم در پوشش، مقاومت به خوردگی پوشش بهبود یافت. همچنین افزودن حدود ۵ درصد اتمی Si به ساختار پوشش موجب افزایش مقاومت خوردگی پوشش و نیز کاهش تحلخل پوشش شد.

**واژه‌های کلیدی:** رسوب بخار فیزیکی، تبخیر قوس کاتدی، خوردگی الکتروشیمیایی، پوشش نیتریدی.

## مقدمه

توسّعه و ترویج پوشش‌های سخت در حوزه ابزار و ماشین‌کاری و همچنین پوشش‌دهی قطعات و قالب‌ها، تحول چشمگیری در صنعت ایجاد کرده است. این پوشش‌ها با توجه به نوع روش پوشش‌دهی و ترکیب شیمیایی دارای ریزساختار، جهت‌گیری بلوری، اندازه دانه، عیوب ساختاری و بافت بلوری متفاوتی هستند [۱، ۲]. پوشش‌های نیتریدی از جمله TiAlN و TiAlN به عنوان اصلی‌ترین نوع پوشش‌های سخت دارای خواص سایشی و سختی بالا، مقاومت اکسیداسیون، ضربه اصطکاک کم و مقاومت شیمیایی بالا هستند [۳]. از جمله روش‌های اعمال پوشش‌های نیتریدی روش تبخیر قوس کاتدی<sup>۱</sup> است. به دلیل ماهیت این فرآیند، عیوب ساختاری همچون خفره، تخلخل و ذرات میکرونی در ساختار این نوع پوشش‌ها وجود دارد [۴].

مقاومت شیمیایی ترکیبات نیتریدی زیاد است، اما در عمل به دلیل وجود عیوب ساختاری در پوشش‌ها، زوج پوشش نیتریدی - زیرلایه رفتاری متفاوت خواهد داشت. بنابراین بررسی رفتار خوردگی این پوشش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است [۵]. طبق بررسی‌های انجام شده وجود تخلخل‌های باز متنه به سطح فلز پایه به دلیل تفاوت در پتانسیل الکتروشیمیایی زوج پوشش-زیرلایه، شرایط را برای ایجاد خوردگی گالوایک و موضعی فراهم می‌سازد [۶].

هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های چند جزئی TiAlCrN ایجاد شده بر فولاد زنگ-زنن ۳۰۴ با استفاده از روش تبخیر قوس کاتدی و نیز تعیین عوامل موثر بر بیود مقاومت خوردگی پوشش‌های ایجاد شده است.

## مواد و روش تحقیق

ورقه‌های فولادی زنگ زنن ۳۰۴ با ضخامت ۱ میلی‌متر در ابعاد ۳ در ۴ سانتی‌متر پولیش شده و پس از چربی‌گیری اولیه درون مثانول و استون در محفظه شستشوی مافوق صوت تمیز کاری شده و سپس خشک شدند. پوشش‌ها روی ورق، پس از اعمال لایه واسط کروم و در ادامه با استفاده از دو تارگت مختلف ترکیبی با خلوص ۹۹ درصد و به طور همزمان در دمای ۲۲۰ درجه سانتیگراد اعمال شدند. در جدول (۱) ترکیب منابع و جریان تبخیر قوس کاتدی متناظر هر کدام از نمونه‌ها آورده شده است. قبل از آغاز فرآیند پوشش‌دهی، برای تمیز کاری و کندو پاش سطحی آلودگی‌ها، آنها در فشار  $5 \times 10^{-2}$  تور و ولتاژ  $800$  ولت، در معرض تحلیله تابان<sup>۲</sup> گاز آرگون قرار گرفتند. در زمان لایه نشانی فشار گاز نیتروژن در محدوده  $3 \times 10^{-2}$  تور بوده و ولتاژ بایاس نمونه‌ها در حین پوشش‌دهی  $100$  ولت انتخاب شد و مدت زمان لایه نشانی  $45$  دقیقه بوده است.

<sup>1</sup> Cathodic Arc Evaporation

<sup>2</sup> Glow Discharge

پس از انجام پوشش دهی، برای بررسی مورفولوژی سطح، مقطع و ترکیب شیمیایی پوشش از میکروسکوپ الکترونی روشنی FEI مجهر به دتکتور طیف‌سنگی پراش انرژی پرتو ایکس<sup>۱</sup> استفاده شد. همچنین برای تحلیل فازی و بررسی ساختار بلوری پوشش از دستگاه پراش پرتو ایکس Philips استفاده شد.

در ادامه آزمون خوردگی الکتروشیمیایی امپدانس با استفاده از دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات ivium در انجام شد. پس از ثبات پتانسیل (۲ ساعت) نمونه‌ها در محدوده فرکانس ۱۰ mHz تا ۱۰۰ kHz و ولتاژ با دامنه ۱۰ mV مورد آزمایش قرار گرفتند و سپس نمونه‌ها تحت آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محدوده ۳۰۰-۲۰۰۰ mV نسبت به پتانسیل مدارباز و با سرعت روش ۱ mV/s مورد آزمون قرار گرفتند.

## نتایج و بحث

با توجه به تفاوت نرخ تبخیر منابع تبخیر کاتدی از جنس‌های مختلف [۷]، ضخامت پوشش‌ها در محدوده ۲/۲ تا ۲/۷ میکرومتر اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی پوشش‌ها مطابق آنالیز انجام شده در جدول (۲) آورده شده است. با افزایش جریان قوس متبع تیتانیوم از ۶۰ به ۸۰ آمپر مقدار تیتانیوم پوشش از ۳۷ درصد به حدود ۶۰ درصد اتمی رسیده است و همچنین در مورد تبخیر منبع ثانویه تیتانیوم-سیلیسیوم در جریان تبخیر ۸۰ آمپر، همچنان نسبت ترکیبی منابع در ترکیب نهایی پوشش ثابت مانده است و این امر نشان‌گر عدم تغییر نرخ تبخیر تیتانیوم با افزودن ۱۰ درصد سیلیسیوم آن است.

برای بررسی مورفولوژی سطح، پوشش‌ها در بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر مورد بررسی قرار گرفتند (شکل ۱)، در تصویر حضور حفراتی سطحی و تعدادی ذرات میکرونی مشاهده می‌شود. به منظور بررسی عیوب احتمالی در مقطع پوشش نمونه‌ها، از مقطع شکست نمونه‌ها تصویربرداری شد. در شکل (۲) در امتداد جهت رشد پوشش، حفراتی مشاهده می‌شود. این حفرات ممکن است در اثر پرش میکروذرات در حین پوشش دهی و در ادامه رشد پوشش در اطراف حفرات قبلی بروز کرده باشند [۴، ۸]. مشاهده می‌شود که بخش اعظم پوشش بدون تخلخل و فشرده است و همچنین ساختار پوشش تقریباً ستونی می‌باشد که غالباً ساختار این نوع پوشش‌ها به این صورت است [۹].

در شکل (۳) الگوی پراش پرتو ایکس سه نمونه آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ساختار پوشش از نوع مکعبی نمک طعام<sup>۲</sup> و تکفار است. حضور اتم‌های با اندازه تقریباً یکسان درون ساختار مکعبی و نیز حضور اتم آلومینیوم علیرغم قطر کمتر باعث شده ثوابت شبکه پوشش‌ها در محدوده‌های مشابه هم قرار گیرند. بر اساس محاسبات انجام شده، اندازه ثابت شبکه نمونه‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۴,۱۹۲، ۴,۲۰۲ و ۴,۲۰۳ آنگستروم آنگستروم است و با افزایش درصد تیتانیوم، ثابت شبکه به نیترید تیتانیوم خالص با ثابت شبکه ۴,۲۲۸ آنگستروم نزدیک می‌شود.

<sup>1</sup>EDS

<sup>2</sup>Rock-salt structure

در نمونه‌های شماره ۱ و ۲ جهت گیری غالب ساختار پوشش، صفحه (۱۱۱) است اما در طیف نمونه شماره ۳ با افزودن حدود ۵ درصد انمی سیلیسیوم، جهت گیری پوشش از صفحه (۱۱۱) به صفحه (۲۰۰) تغییر یافته است. علاوه بر این در الگوی پراش، اثری از حضور ترکیبات بلوری سیلیسیوم، همچون سیلیسیوم عنصری و نیترید آن مشاهده نمی‌شود. این امر نشانگر حضور نیترید سیلیسیوم به صورت آمورف در ساختار شبکه است و پهن شدگی پیک‌ها و کاهش نسبی شدت ماکریسم پیک‌ها مولید این امر است [۱۰، ۱۱]. تحلیل دقیق تر ساختار نانوکامپوزیت متدالوی این پوشش‌ها نیازمند بررسی طیف سنجی فتوالکترون اشعه ایکس و تصویربرداری الکترونی عبوری است که در این مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

مطابق بررسی محققان مختلف در مورد امپدانس پوشش‌های نیتریدی تبخیر قوس کاتدی و کندوپاش، مدل‌های مشابه جهت تحلیل خواص پوشش و تعیین عناصر مدار معادل انجام شده است [۶، ۱۲-۱۴]. بر اساس تحلیل‌ها، مدار معادل مناسب برای رفتار زیر لایه (QR) و جهت نمونه‌های پوشش داده شده مدار R(C(R(QR))) است. بر اساس تحلیل‌ها، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت (شکل (۴)).  $R_p$  و  $R_{ps}$  به ترتیب مقاومت محلول، مقاومت حفره در برابر انتقال بار و یون و مقاومت پلاریزاسیون فلز هستند. المان‌های Coat و CPE به ترتیب ظرفیت خازنی پوشش‌ها و المان فاز ثابت سطح فلز و یا ظرفیت خازنی لایه پسیو سطح فولاد زنگ نزن هستند. نتایج تحلیل پوشش‌ها در جدول (۳) آورده شده است. بر اساس این نتایج مقاومت پلاریزاسیون نمونه شماره ۳ بیشترین مقدار است. و باقی پارامترهای پوشش‌ها نقریباً مشابه هم بوده و اختلاف چندانی ندارد، کم بودن مقاومت حفرات به دلیل کم بودن ضخامت و درنتیجه نفوذ و رسوخ آسان محلول و یون‌ها به داخل پوشش بروز کرده است.

بر اساس آزمون پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک، پوشش‌های ایجاد شده منجر به محافظت در برابر خوردگی فولاد زیرلایه شده‌اند. نتایج بدست آمده از پلاریزاسیون پوشش‌ها در جدول (۴) آورده شده است. ملاحظه می‌شود که با افزایش درصد تیتانیوم، رفتار سیستم الکتروشیمیایی متفاوت است. در پوشش با درصد آلومینیوم بیشتر (نمونه شماره ۱) منطقه رویین شدن پایدارتر است، در نمونه شماره ۲ و ۳، علی‌رغم اینکه پتانسیل خوردگی به مقادیر منفی‌تر حابجا شده‌اند، جریان خوردگی کاسته شده است. مطابق شکل (۵) مشاهده می‌شود در نمونه شماره ۳ با افزودن سیلیسیوم، جریان خوردگی کاسته شده است و این در حالی است که رفتار کلی خوردگی آن، مشابه نمونه شماره ۲ است.

به‌منظور تخمین مقدار تخلخل پوشش‌ها از معادله (۱) استفاده شد. در این حالت فرض می‌شود که پوشش نیتریدی در مقادیر کم فراتانسیل آندی رفتاری خنثی دارد [۱۲، ۱۵].

$$P = \left( R_{ps}/R_p \right) \times 10^{-|\Delta E_{corr}|/\beta_a} \quad (1)$$

در معادله فوق،  $R_{ps}$  و  $R_p$  به ترتیب مقاومت پلاریزاسیون زیرلایه و پوشش است،  $\Delta E_{corr}$  تفاصل پتانسیل خوردگی پلاریزاسیون بین دو نمونه زیرلایه و نمونه پوشش داده شده است و  $\beta_a$  شیب تألفی آندی زیرلایه است.

همچنین معادله‌ی (۲) جهت تعیین مقدار بازده حفاظتی پوشش استفاده شده است. در این معادله نیز  $i_{\text{corr}}^0$  و  $i_{\text{corr}}$  به ترتیب دانسته حریان خوردگی نمونه پوشش دار و زیرلایه است.

$$P_i(\%) = 100 \left( 1 - \frac{i_{\text{corr}}}{i_{\text{corr}}^0} \right) \quad (2)$$

تخلخل محاسبه شده از پوشش‌ها به نحوی بیانگر میزان سطح تماس محلول خورنده و زیرلایه فولادی است و با افزودن عنصر سیلیسیوم ساختار پوشش متراکم‌تر شده و مقاومت خوردگی پوشش افزایش می‌یابد. درصد حفاظت در برابر خوردگی پوشش‌ها برای نمونه‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب ۶۸، ۲۲ و ۴۴٪ و ۹۰٪ بدست آمد و نشانگر بهبود خواص حفاظتی پوشش‌های ایجاد شده است.

### نتیجه‌گیری

۱) با استفاده از نسبت‌های مختلف حریان قوس کاتدی منابع تبخیری، پوشش‌های مختلف با درصد های متفاوتی از تیتانیوم و سیلیسیوم بدست آمد. پوشش‌های حاصل بر اساس آنالیز طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس به ترتیب با افزایش حریان قوس کاتدی  $Ti_{56}Al_{30}Cr_{14}$ ،  $Ti_{37}Al_{42}Cr_{21}$  و  $Ti_{52}Al_{30}Cr_{14}Si_5$  بدست آمد.

۲) با اعمال پوشش چند جزئی  $TiAlCrN$  مقاومت خوردگی زیرلایه ۶ تا ۱۷٪ برابر و شاخص حفاظت تا ۹۰٪ درصد افزایش یافت، لذا استفاده از این پوشش می‌تواند راهکاری مناسب جهت بهبود خوردگی قطعات توامبا سختی بالا باشد.

۳) با افزایش ۲۰٪ درصدی تیتانیوم در پوشش، مقاومت خوردگی پوشش افزایش یافت و همچنین با افزودن ۵٪ درصد عنصر سیلیسیوم به ترکیب، مقاومت خوردگی پوشش نسبت به نمونه‌های دیگر بهبود می‌یابد و علاوه بر این درصد تخلخل پوشش نیز کاسته می‌شود.

### تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از همکاری صمیمانه مدیریت و مجموعه همکاران شرکت فناوران سخت آرامستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تشکر نماییم.

### مراجع

1. P. H. Mayrhofer, C. Mitterer, L. Hultman *et al.*, "Microstructural design of hard coatings," *Progress in Materials Science*, vol. 51, no. 8, pp. 1032-1114, 2006.
2. B. North, "Six issues for the hard coatings community," *Surface and Coatings Technology*, vol. 106, no. 2-3, pp. 129-134, 8/4/, 1998.
3. Y.-p. Feng, L. Zhang, R.-x. Ke *et al.*, "Thermal stability and oxidation behavior of AlTiN, AlCrN and AlCrSiWN coatings," *International Journal of Refractory Metals & Hard Materials*, vol. 43, pp. 241-249, Mar, 2014.
4. P. Panjan, M. Čekada, M. Panjan *et al.*, "Growth defects in PVD hard coatings," *Vacuum*, vol. 84, no. 1, pp. 209-214, 2009.

5. H. A. Jahn, "Improvement of the corrosion resistance of PVD hard coating–substrate systems," *Surface and Coatings Technology*, vol. 125, pp. 212–217, 2000.
6. C. Liu, Q. Bi , A. Leyland *et al.*, "An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I. Establishment of equivalent circuits for EIS data modelling," *Corrosion Science*, vol. 45, no. 6, pp. 1243–1256, 2003.
7. A. Anders, *Cathodic Arcs From Fractal Spots to Energetic Condensation*, 2008.
8. B. Window, "Issues in magnetron sputtering of hard coatings," *Surface and Coatings Technology*, vol. 81, no. 1, pp. 92-98, 5/1, 1996.
9. A. Anders, "A structure zone diagram including plasma-based deposition and ion etching," *Thin Solid Films*, vol. 518, no. 15, pp. 4087-4090, 2010.
10. C. Wanglin, Z. Jie, L. Yue *et al.*, "Comparison of AlCrN and AlCrTiSiN coatings deposited on the surface of plasma nitrocarburized high carbon steels," *Applied Surface Science*, vol. 332, pp. 525-32, 30 March, 2015.
11. Y. H. Cheng, T. Browne, B. Heckerman *et al.*, "Influence of Si content on the structure and internal stress of the nanocomposite TiSiN coatings deposited by large area filtered arc deposition," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 42, no. 12, pp. 125415, 2009.
12. L. Zhang, Y. Chen, Y.-p. Feng *et al.*, "Electrochemical characterization of AlTiN, AlCrN and AlCrSiWN coatings," *International Journal of Refractory Metals and Hard Materials*, vol. 53, pp. 68-73, 2015.
13. Y. S. C. S.H. Ahn, J.G. Kim, J.G. Han, "A study on corrosion resistance characteristics of PVD Cr-N coated steels by electrochemical method," *Surface and Coatings Technology*, vol. 150, pp. 319–326, 2002.
14. O. M. S. Quintero, W. A. Chaparro, L. Ipaz *et al.*, "Influence of the Microstructure on the Electrochemical Properties of Al-Cr-N Coatings Deposited by Co-sputtering Method from a Cr-Al Binary Target," *Materials Research*, vol. 16, no. 1, 2014.
15. J. Creus, H. Mazille, and H. Idrissi, "Porosity evaluation of protective coatings onto steel, through electrochemical techniques," *Surface and Coatings Technology*, vol. 130, no. 2–3 ,pp. 224-232, 8/21/, 2000.

شانزدهمین سیمار ملی مهندسی سطح

جدول ۱: شرایط پوشش دهنده نمونه ها و جنس منابع تبخیری

نمونه	جریان فوس کاتدی منبع (A)		
	AlCr (70:30)	Ti	TiSi (90:10)
نمونه ۱	۱۰۰	۶۰	-
نمونه ۲	۱۰۰	۸۰	-
نمونه ۳	۱۰۰	-	۸۰

جدول ۲: نسبت ترکیبی عناصر پوشش ها بر مبنای آنالیز

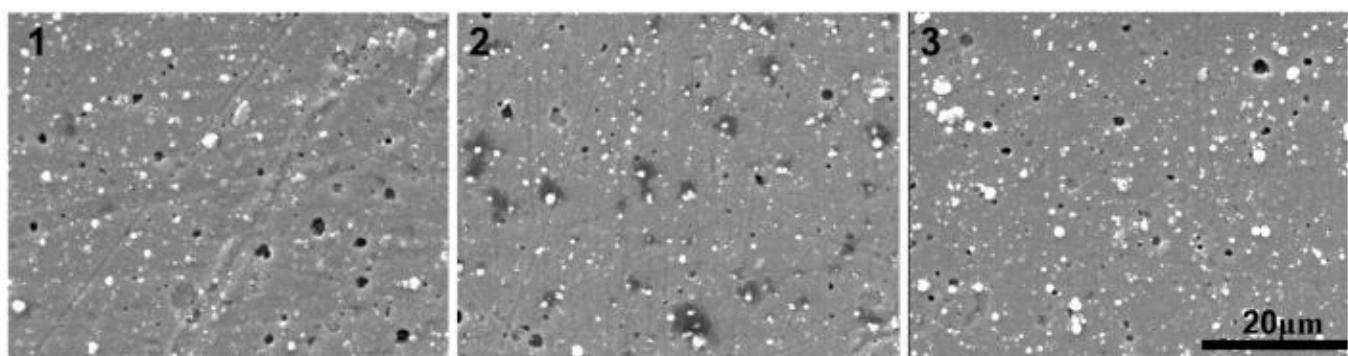
	نسبت ترکیب منابع فوس		درصد عناصر فلزی پوشش (at%)			
	AlCr/Ti	AlCr/TiSi	Ti	Al	Cr	Si
نمونه ۱	۶۳:۳۷		۳۷,۲	۴۱,۸	۲۰,۹	-
نمونه ۲	۴۴:۵۶		۵۵,۸	۲۹,۷	۱۴,۴	-
نمونه ۳		۴۳:۵۷	۵۱,۷	۲۹,۲	۱۳,۹	۵,۲

جدول ۳: نتایج آزمون امپدانس و ثبات پوشش بر مبنای انطباق مدار معادل

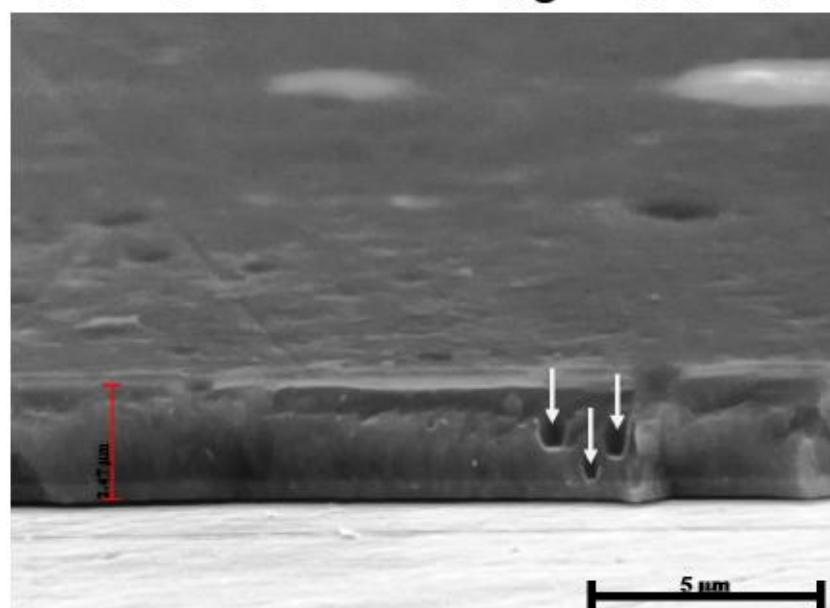
نمونه	$R_s$ ( $\Omega \cdot \text{cm}^2$ )	$C_{coat}$ ( $\mu\text{F} \cdot \text{cm}^{-2}$ )	$R_{pore}$ ( $\Omega \cdot \text{cm}^2$ )	$CPE$ ( $\mu\text{F} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{(1-\alpha)}$ )	$\alpha$	$R_{pol-s}$ ( $k\Omega \cdot \text{cm}^2$ )
زیرلايه	۱۱,۷۲			۸۴,۵۸	۰,۸۵	۶,۹
نمونه ۱	۱۱,۵۶	۰,۱۳۳	۱۲,۴۶	۶۱,۲۸	۰,۸۹	۱۲۲,۳۱
نمونه ۲	۱۱,۷۶	۰,۱۰۹	۱۱,۸۶	۸۳,۲۰	۰,۹۱	۴۶۳,۹۳
نمونه ۳	۱۲,۱۵	۰,۱۰۷	۱۲,۶۴	۴۹,۴۷	۰,۸۵	۱۷۱۰,۰۴

جدول ۴: نتایج آزمون خوردگی پلاریزاسیون پوشش ها

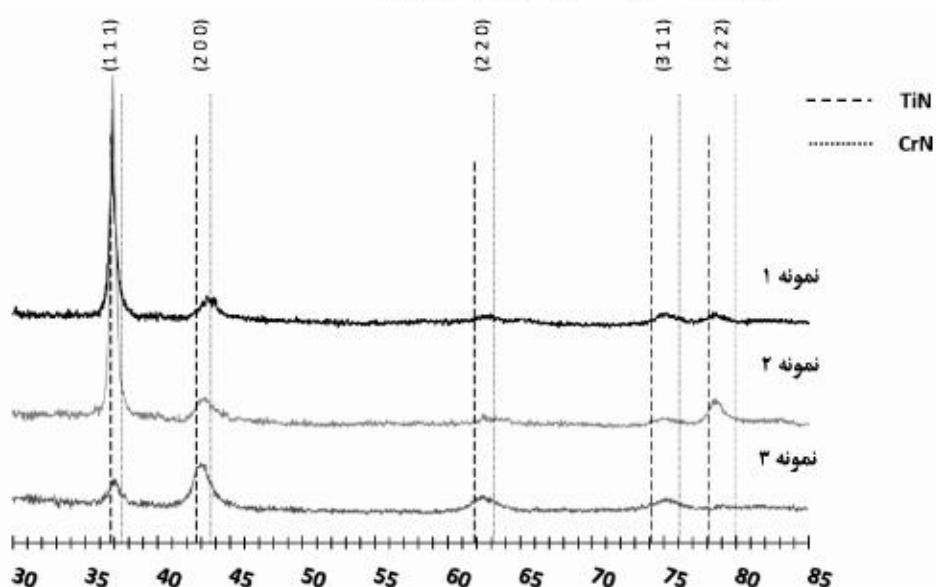
نمونه	پتانسیل V vs. (SCE)	جریان ( $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ )	شب آندی (V/decade)	شب کاتدی (mV/decade)	شب کاتدی ( $k\Omega \cdot \text{cm}^2$ )	نرخ تخلخل مقاومت پلاریزاسیون (%)
زیرلايه	۴۷۳,۱	۴,۹۳	۱۲۴,۸۶	۵۲,۴۳	۳۲۵۴	-
نمونه ۱	۴۲۴,۷	۱,۰۷	۲۴۷,۵۳	۱۰۱,۷۳	۱۹۷۴۰	۶,۶۳
نمونه ۲	۴۷۰,۳۵	۰,۸۶۷	۱۶۵,۴۱	۱۰۷,۲۵	۳۲۲۲۵	۹,۶۰
نمونه ۳	۵۴۸,۱۱	۰,۴۷۸	۱۸۱,۴	۹۹,۳۵	۵۷۵۸۱	۱,۴۲



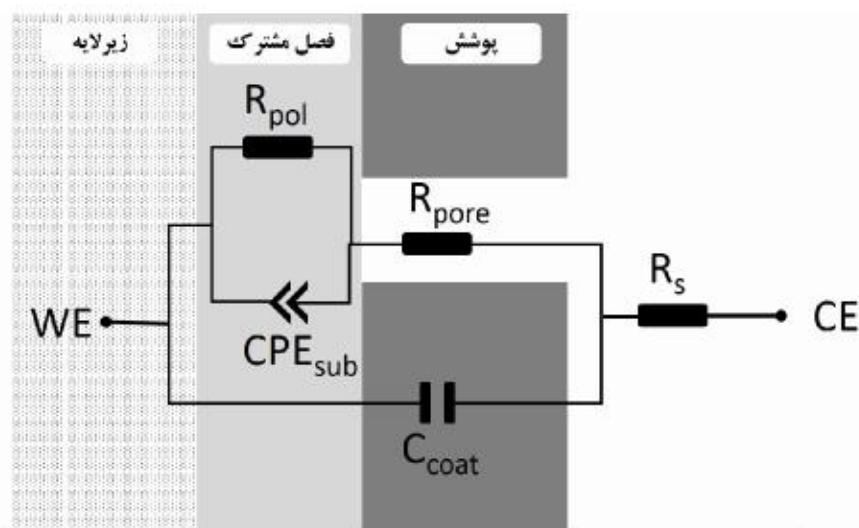
شکل-۱: مورفولوژی سطح پوشش های ۱، ۲ و ۳ (بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر).



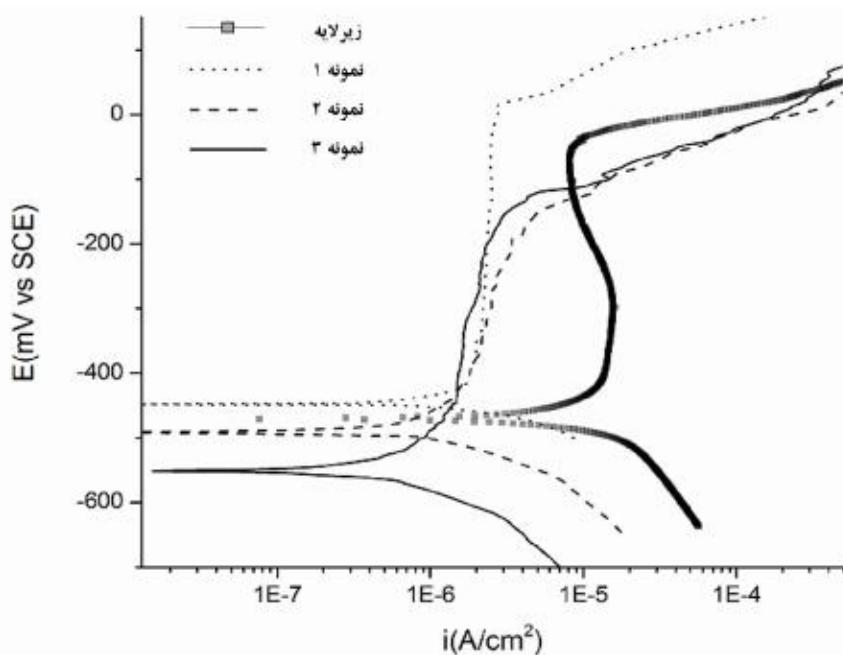
شکل-۲: تصویر میکروسکوپی الکترونی رویشی از سطح مقطع شکست پوشش نمونه شماره ۳، در تصویر محل قرار گیری عیوب حفره در پوشش با پیکان نشان داده شده است.



شکل-۳: طیف تفرق پرتو ایکس پوشش ها به همراه موقعیت پیک های نیترید تیتانیوم و کروم خالص.



شکل-۴: شماتیک مدار معادل تحلیل امپدانس پوشش-زیر لایه به همراه نمایش معادل فیزیکی آن.



شکل-۵: نمودار پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک نمونه های پوشش داده شده و زیر لایه ۳۰۴